(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 11. März 2004 (11.03.2004)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/021229 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: G05B 13/02

G06F 17/60,

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE2003/002707

(22) Internationales Anmeldedatum:

11. August 2003 (11.08.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

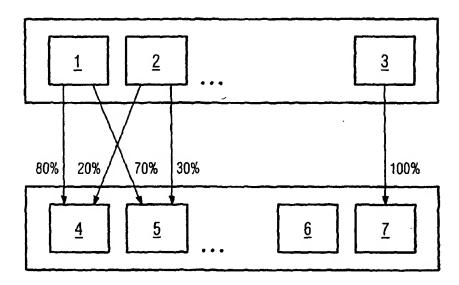
102 38 831.8

23. August 2002 (23.08.2002) DE

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BOURIANT, Alexandre [FR/DE]; Geranienstrasse 4, 76185 Karlsruhe (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaat (national): US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: METHOD AND DEVICE FOR OPTIMIZING PROCESSES
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR PROZESSOPTIMIERUNG



(57) Abstract: The invention relates to a process-optimizing device, particularly a manufacturing execution system (MES) device. Such a process-optimizing MES device is mounted between an enterprise production planning system, especially an enterprise resource planning (ERP) device, and a control system, particularly a process instrumentation and control (PLT) device. The inventive MES device comprises at least one optimization unit (1, 2, 3) for influencing one or several process parameters of the control system, especially the PLT device, at least one data-determining unit (33) for monitoring the process parameter/s, and at least one evaluation Such a process-optimizing MES device is mounted between an enterprise production planning system, especially an enterprise reunit (4, 5, 6, 7) for automatically determining an optimization of the process parameter/s, which is created by the optimization unit/s